

• Hysitron PI 89 SEM PicoIndenter

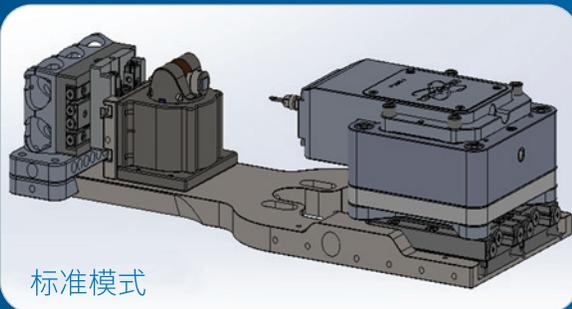
Hysitron PI 89 SEM PicoIndenter

Hysitron PI 89 SEM PicoIndenter 利用扫描电子显微镜 (SEM、FIB/SEM) 的卓越成像能力, 可以在成像的同时进行定量纳米力学测试。这套全新系统搭载Bruker领先的电容传感技术, 继承了引领市场的第一批商业化原位SEM纳米力学平台的优良功能。多年来, Hysitron系列产品稳步拓展PicoIndenter的应用范围, 并利用专利xR传感技术和其他独家先进技术扩展了力和位移量程。PI 89拥有多项创新功能, 包括电特性模块 (ECM)、薄膜和纳米线压转拉模块 (PTP)、直接拉伸测试、疲劳测试、旋转和倾斜台 (已获专利)、高温测试及纳米划痕等。PI 89是现有的功能最全面用于SEM和 FIB/SEM 的原位纳米力学测试仪。

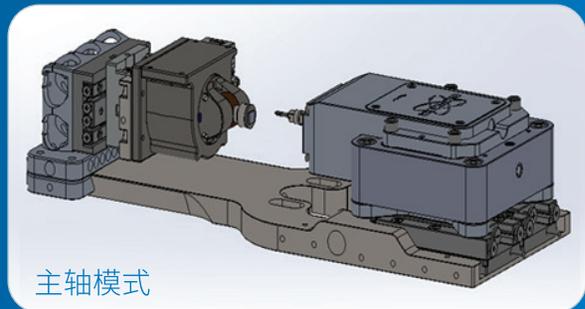
Hysitron PI 89 的功能

- 独有的可互换传感技术, 实现了更大范围 (10mN、500 mN、3.5 N 和150 μm) 的原位纳米力学测试和微尺度力学测试
- 独有的载荷和位移控制测试模式, 可进行纳米压痕、压缩、拉伸、疲劳或弯曲测试
- 采用全新编码样品台技术 (1 nm 分辨率), 可以在纳米晶粒内部进行压痕操作
- 提供旋转/倾斜台两种配置, 从而在进行纳米力学测试、二次电子成像、原位 FIB 加工和分析成像等操作时, 样品定位能力进一步提高
- 采用永不过时的模块化设计, 原位测试相关技术得以不断升级, 包括 800°C 加热、划痕测试、电特性、扫描探针显微镜 (SPM) 成像、力学性能成像 (XPM) 及动态疲劳测试等技术
- 配备 Performech® II 先进控制模块, 反馈频率达到 78 kHz, 数据采集频率达到 39 kHz, 可以捕捉断裂引发等瞬时事件

采用新一代系统设计, 提供旋转/倾斜台两种配置



标准模式



主轴模式

性能卓越, 功能齐备

Hysitron PI 89 可以轻松安装到扫描电子显微镜台上, 不需要一直固定在显微镜上。其设计小巧, 大幅增加物台倾斜度、缩短工作距离, 确保测试期间实现最佳成像。PI89 平台经过改装, 在系统的样品位置增加了一个滑移台。与行业内标准的PI 88系统相比, 功能更多样、使用更方便。该设计可方便快速地调整样品相对于传感器的位置, 并可配置可更换压头、样品和其它附加装置。同时扩大了可用空间, 可以容纳更大的样品、附加样品台和新的配件。

此外, 选用新的直线编码样品台, 可以提高自动运动中的重复性, 同时扩大行程范围。通过重新设计机械载荷架轴, 提升了框架刚度。

平台设计升级, 采用 Bruker 最先进的 xR 传感器, 并且能够与现有的 PI 88 纳米划痕、XPM、SPM、高温测试以及旋转/倾斜台等选装配件兼容。另外, 还可充分兼容ECM、直接拉伸模块、压转拉模块 (PTP)、nanoDynamic、自动压痕、EBSD、TKD 和 STEM 等选装配件。

Hysitron PI 89 SEM PicoIndenter 规格

最大力	标准载荷: 10 mN; 高载荷: 0.5 N 新的高载荷选项: >3.5 N
力噪声* (SEM 内部, 60Hz)	<0.4 μ N; <5 μ N; 30 μ N
力噪声 (理想环境下, 60Hz, 10 mN 传感器)	<50 nN
最大位移	150 μ m
位移噪声* (SEM 内部, 60Hz)	<1 nm
位移噪声基底 (理想环境下, 60Hz, 10 mN传感器)	<0.1 nm
机械刚度 (N/m)	0.9×10^6
样品定位范围	12 mm x 26 mm x 29 mm (压痕轴)
样品定位灵敏度	1 nm (编码)
系统宽度、高度、长度 (基底系统)	68 mm、42 mm、191 mm
系统基本重量	480g
多样品安装	是
自动压痕测试/ 快速测试 (XPM)	更大面积: (>1 mm x >1 mm)
旋转和倾斜台	两种配置
定位自由度	每种配置下包括 5 个自由度
样品主轴模式旋转	是

*安装现场指标

布鲁克纳米表面仪器部

北京办公室电话: 010-58333257

上海办公室电话: 021-51720811

广州办公室电话: 020-22365885

客户服务热线: 400-890-5666

邮箱: BNS.China@bruker.com

网址: www.bruker.com/nano

www.bruker.com/hysitron-pi-89

